

波長可変半導体レーザー (TDL) HCl測定用



HClの高性能測定

GPro 500は、スクラバータワー、燃料ガス、VCMなどの困難な用途でも信頼性の高いHCl測定を提供します。



低いメンテナンスコストと運用コスト

このHCl分析計は、メンテナンスが必要なコンディショニングシステムを必要とせず、in-situ測定を行えるため、総所有コストを削減できます。



容易な設置

この分析計は、調整不要のTDLガス分析計のため、TDLの設置や調整の一般的な課題を大幅に削減します。



過酷な環境に適した設計

GPro 500は構成可能なため、様々なプロセス適合オプションと組み合わせることで、幅広い設置要件にも適合し、正確な塩化水素ガス測定を提供します。



GPro 500 TDL分光計 HClモニタリング用

塩化水素 (HCl) ガス分析計GPro® 500は、困難な用途での高性能測定用に設計された、独自の波長可変半導体レーザー分光計です。レーザー吸収分光法を採用し、シンプルな設置と高い精度のHCl測定を実現しています。このHClガス分析計は、スタックやスクラバーでのHClモニタリングなどの用途に理想的です。環境および規制のニーズを満たすために、これらの波長可変半導体レーザーガス分析計は正確で信頼性が高い高速測定を提供します。GPro 500 HClガス分析計は、in situで設置できるため、サンプルを抽出・調整する必要がなく、高速応答を実現します。これは、ガスの抽出と調整を必要とする技術に代わる、信頼性と費用対効果の高い技術です。

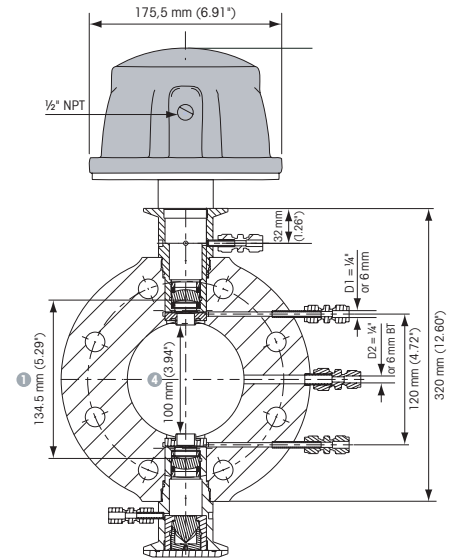
HCl分析計GPro 500の技術データ¹⁾:

測定対象ガス	塩化水素
低い検出制限	0.6 ppm-v
測定範囲	0~3%
精度	読み取り値の2%または0.6 ppm (いずれか大きい方)
直線性	1%以上
分解能	0.6 ppm-v
ドリフト	無視可能 (メンテナンス間隔の測定範囲の2%未満)
サンプリングレート	1 秒
応答時間 (T90)	N ₂ 中のHCl 4秒未満で1%~0%
繰返し性	読み取り値の±0.25%または3 ppm-v HCl (いずれか大きい方)
プロセス圧力範囲	0.8 bar~3 bar (abs)
プロセス温度範囲	0~250°C 標準 0~600°C 追加サーマルバリア付き 0~150°C PFAまたはPTFEフィルター付き
有効光路長	50 mm~800 mm、適応により異なる

1) 標準的な条件下 (有効光路長1 m、標準的な圧力 (P) と温度 (T)、埃や微粒子なし)。

GProはメトラー・トレドグループの登録商標です。

▶ www.mt.com/HCl-Analyzer



ウエハセル型GPro 500の設置例。



メトラー・トレド株式会社
プロセス機器事業部
お問い合わせ: www.mt.com/pro-MOs

仕様は予告なく変更する場合があります
© 2021年10月 METTLER TOLEDO
All rights reserved. PA2102ja A
MarCom Urdorf, CH

www.mt.com/pro

詳細はウェブサイトをご覧ください